

全自動水平型多目的粉末 X 線回折装置

先端機分析センター 303 室



仕様	
型名	リガク株式会社 Smart lab
X 線発生部	定格出力 3kW, Cu ターゲット
入射光学系	集中法, 平行法
受光光学系	ソーラースリット, Ge ₂ 結晶
検出器	シンチレーションカウンタ, 一次元半導体検出器
測定の種類	2θ-θ, 薄膜法, ロッキングカーブ, 極点, 反射率, 小角散乱など
付属装置	オートサンプラー, 温度制御装置